

平成 25 年 2 月 13 日

平成 24 年度 第 2 回 分析技術セミナー

－新規導入装置のご紹介－

新潟県工業技術総合研究所
下越技術支援センター

製品の品質化・高付加価値化に伴って、材料に対する多様な分析技術が求められるようになってきました。当センターでは昨年度、いくつか装置を更新・新規導入しニーズへの対応に努めてきました。

このたび、導入した装置の原理、特徴・機能や応用例を紹介し、皆様の製品開発やトラブル解析にお役に立てるようにセミナーを企画しました。ふるってご参加いただきますようご案内申し上げます。

記

- 日 時** 平成 25 年 3 月 8 日 (金) 13:00～17:00
場 所 新潟県工業技術総合研究所 301 会議室
〒950-0915 新潟市中央区鏡西 1-11-1 (新潟駅から徒歩 15 分)
URL: <http://www.iri.pref.niigata.jp>
- 内 容** 次頁にセミナー次第(詳細)を載せましたのでご覧下さい。
* 分析技術セミナー
(1) X線光電子分光による表面分析
(2) イオンクロマトグラフィーの特徴と分析事例
(3) 赤外イメージングによる化学構造分布解析
* 装置見学
- 定 員** 30 名
受講料 無料
申込方法 参加申込書にご記入いただき、3月7日までに FAX またはメールでお申し込みください。

平成 24 年度 分析技術セミナー 参加申込書

申込先：下越技術支援センター 永井 宛

FAX: 025-241-5018 e-mail: nnagai@iri.pref.niigata.jp

貴社名	住所	
TEL	FAX	
役職	氏名	E-mail アドレス

* ご記入いただいた情報は、新潟県からの連絡、情報提供のみに利用させていただきます。

分析技術セミナー次第

13:00～13:05

受付

13:05～13:10

あいさつ

13:10～16:00

分析技術セミナー

1. X線光電子分光による表面分析(13:10-14:10)

下越技術支援センター 専門研究員 諸橋春夫

X線光電子分光分析装置は、各種材料・製品の最表面における元素、化学結合などを分析・解析する表面分析装置です。本セミナーでは、X線光電子分析の概要、原理、分析事例を説明し、昨年度当センターに導入された装置についての特徴についてもお話しします。

2. イオンクロマトグラフィーの特徴と分析事例(14:10-15:00)

下越技術支援センター 研究員 渡辺 亮

昨年度導入した当該装置に関する特徴及びプラズマ発光分光分析装置等との比較分析事例について紹介します。

休憩 (15:00-15:10)

3. 赤外イメージングによる化学構造分布解析 (15:10-16:00)

下越技術支援センター 主任研究員 岡田英樹

昨年度導入された赤外イメージングは化学構造としての分布が測定できる装置です。本分析法の特徴と応用例について紹介します。

16:00～16:30

装置見学

16:30～17:00

質疑応答

※問い合わせ先：新潟県工業技術総合研究所下越技術支援センター 永井 TEL:025-244-9168

